JTEKT 半導体製造工程内で活用できる製品シリーズ ①

エッジグラインダ用スピンドル

高精度

高速・低振動・高精度

光洋機械工業株式会社

ウェーハ両頭平面研削盤

トレーサビリティ

クリーン

300mm ウェーハ

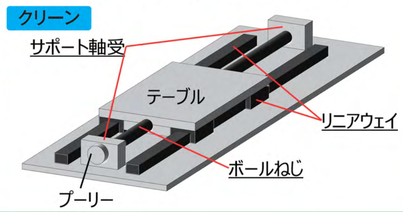
DXSG320

従来の「両面ラップ+片面研削工程」を一台で全自動研削

光洋機械工業株式会社

縦型拡散炉テーブルユニット用軸受

クリーン



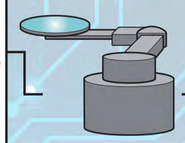
ボールねじ、リニアウェイ、サポート軸受

ウェーハ搬送装置用軸受ユニット

クリーン 真空 耐食

軸受ユニット互換品、軸受交換を含む

ウェーハ搬送



ウェーハ搬送装置用ベアリング

クリーン

組合せ セラミック軸受

耐食

クリーン

真空

コロガードプロ ベアリング®-MD

Kシリーズ組合せ セラミック軸受

低発塵、長寿命の薄肉型軸受

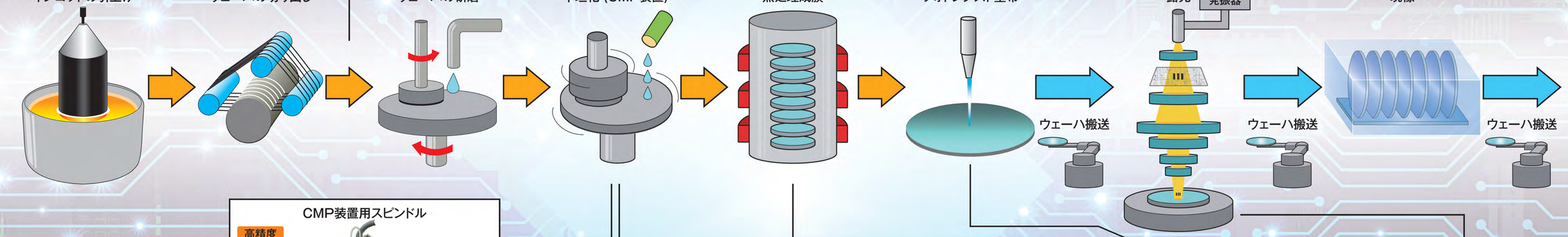
レーザー発振器用ベアリング

耐食

コロガードプロベアリング®-AZ

発振器内の特殊ガスに耐食性のあるベアリング

次ページへ



CMP装置用スピンドル

高精度

耐食

高剛性・高精度

光洋機械工業株式会社

CMP装置用ベアリング

耐食

コロガードプロベアリング®-SC,AZ

クリーン

EXSEV®-EX

研磨具回転部と腐食液に接する部位では異なるタイプが採用される

熱処理成膜装置用ベアリング

高温

クリーン

クリーンプロ®-RB

高温

EXSEV®-PN EXSEV®-WS

高温下でも潤滑可能な特殊仕様のベアリング

縦型熱処理システム

クリーン

300mm ウェーハ

VF-5900

酸化・拡散・LP-CVD 他各種プロセスに対応可能

光洋サーモシステム株式会社

フォトレジスト塗布装置用ベアリング

クリーン

EXSEV®-EX

クリーン環境でのグリース潤滑ベアリング

露光装置用ベアリング

クリーン

Newクリーンプロ®-PR

非磁性

組合せ セラミック軸受

非磁性組合せ セラミック軸受

クリーン仕様や非磁性材料であるセラミックスを採用したベアリング

様々に工程に

クリーン 真空

EXSEV®-EX（グリース）

クリーン 真空

特殊環境用リニア玉軸受

クリーン 真空

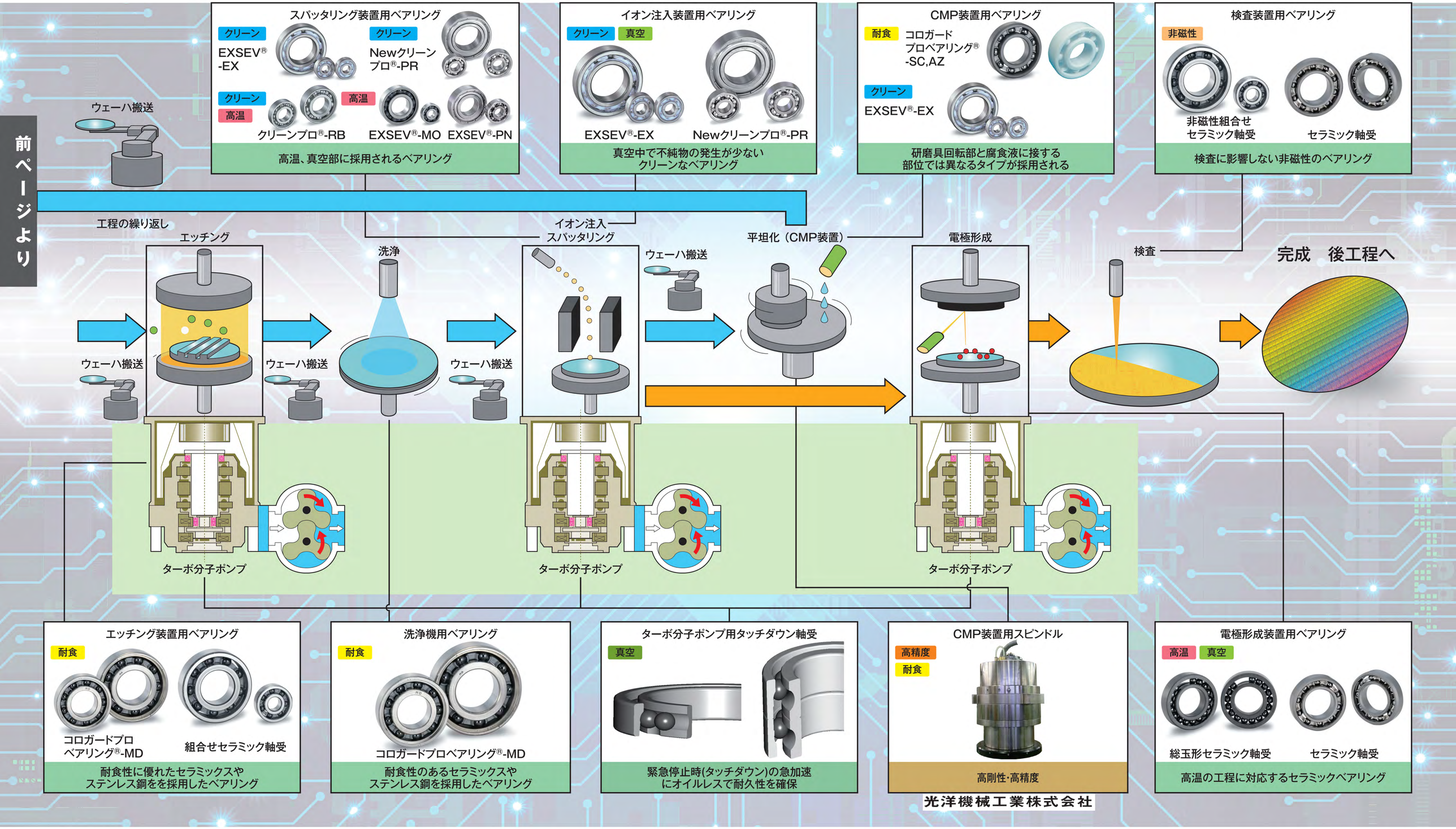
特殊環境用リニアウェイ

クリーン、真空対応のグリース単品、直動各種

株式会社ジェイテクト

CAT.NO.BA021JA-0MY

JTEKT 半導体製造工程内で活用できる製品シリーズ ②



•様々な製造装置に純正採用されているJTEKT グループ の技術力が、製造装置の補修用にもお役に立ちます。

株式会社ジェイテクト

CAT.NO.BA021JA-0MY